응집물질물리실험 결과보고서

실험주제 : Hall effect

HuiJae-Lee^{1, *}

¹Physics Department, Inha University (Dated: November 11, 2022)

반도체에 걸리는 홀 전압의 크기가 외부 자기장에 비례하여 커지고 반도체에 흐르는 전류의 크기에 대해서도 비례하여 증가함을 관찰하였다. 또한 외부 자기장과 홀 전압으로부터 시료의 홀 계수를 구하였다.

I. PROCESS

- 1. 가우스미터를 통해 전자석의 자기장 크기를 전류의 값으로 치화한다.
- 2. 전자석의 자기장 세기를 6000 G까지 100 G씩 올려가며 가우스미터의 전류 값을 기록한다.
- 3. p형 반도체 샘플이 전자석의 중앙에 위치하도록 조 정하고 홀 전압 측정 장치에 연결한 후, 측정 장치 의 off set을 0으로 설정한다.
- 4. 샘플에 흐르는 전류를 측정할 값(2 mA, 4 mA, 6 mA)에 맞춘 후, 자기장을 올려가며 홀 전압을 측정한다.
- 5. 샘플을 n형 반도체로 교체하여 과정 3, 4를 반복한 다.

II. RESULT

A. p-type

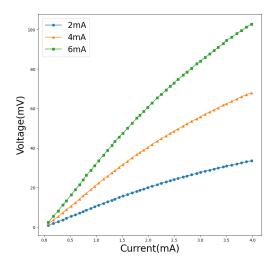


FIG. 1. 전자석에 흐르는 전류에 따른 p형 반도체의 홀 전압 그래프

p형 반도체의 경우, offset을 0으로 잘 설정하여 실험을 진행하였다.

B. n-type

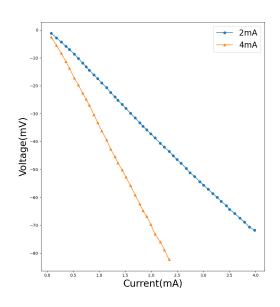


FIG. 2. 전자석에 흐르는 전류에 따른 p형 반도체의 홀 전압 그래프

n형 반도체의 경우 offset이 잘 설정되지 않아 반도체에 2 mA가 흐르는 조건에서 자기장이 0 G일 때 홀 전압이 -37.5 mV, 4 mA가 흐르는 조건에서 자기장이 0 G일 때 홀 전압이 -115.3 mV 만큼 걸리는 것을 측정하였다. 홀 전압을 측정하는 기기가 200 mV 이상의 전압을 측정하지 못해 4 mA가 흐르는 조건에서 자기장이 3000 G 이상일 때 홀 전압을 측정하지 못하였고 6 mA가 흐르는 조건에서 홀 전압을 전혀 측정하지 못하였다.

^{*} hjlee6674@inha.edu

III. ANALYSIS

실험에 사용한 시료의 두께는 $0.05~\mathrm{cm}$ 로 홀 계수 R_H 를 다음의 공식으로부터 구할 수 있다.

$$R_H = \frac{dV_H}{IB} \tag{1}$$

 d, V_H, I, B 는 각각 시료의 두께, 홀 전압, 시료에 흐르는 전류, 외부 자기장이다.

A. p-type

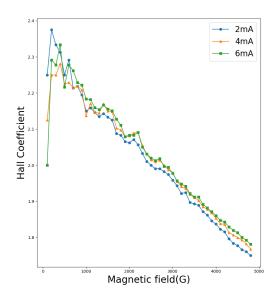


FIG. 3. 외부 자기장에 따른 p형 반도체의 홀 계수

실험으로부터 얻은 측정값(외부 자기장, 홀 전압)으로 부터 구한 외부 자기장에 따른 p형 반도체의 홀 계수를 FIG. 3과 같이 그래프로 그릴 수 있다. 반도체에 흐르는 전류에 따른 홀 계수의 평균값은 다음과 같다.

Current	Average Hall Coefficient
2 mA	$2.019940377 \times 10^{-6}$
4 mA	$2.024756306 \times 10^{-6}$
6 mA	2.032621037×10^{-6}

TABLE I. p형 반도체에 흐르는 전류에 따른 홀 계수의 평 균값

반도체에 흐르는 전류가 높을 수록 홀 계수가 평균적으로 증가하였고, 반도체에 흐르는 전류에 관계없이 외부자기장이 클 수록 홀 계수가 낮아지는 양상을 확인할 수있었다.

B. n-type

p형 반도체의 경우와 마찬가지로 외부 자기장에 따른 n형 반도체의 홀 계수를 FIG. 4과 같이 그래프로 그릴

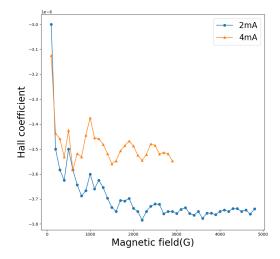


FIG. 4. 외부 자기장에 따른 n형 반도체의 홀 계수

Current	Average Hall Coefficient
2 mA	$-3.694702113\times10^{-6}$
4 mA	$-3.484390053 \times 10^{-6}$

TABLE II. n형 반도체에 흐르는 전류에 따른 홀 계수의 평 균값

수 있다. 위에서 언급하였듯이 n형 반도체의 경우 4 mA가 흐르는 조건에서 홀 전압을 2900 G 까지만 측정할 수 있었고 6 mA가 흐르는 조건에서 홀 전압을 측정할 수 없어 FIG. 4에는 2개의 그래프가 그려져 있다. 반도체에 흐르는 전류에 따른 홀 계수의 평균값은 다음과 같다.

n형 반도체의 경우 홀 계수의 평균값의 차가 p형 반도 체의 경우보다 10배 가까이 크게 나타났다.

IV. CONCLUSION

우선 가우스미터를 통해 전자석의 자기장 크기를 전류 값으로 치환하였을 때 전류값은 자기장에 거의 선형적인 모습으로 나타났다(FIG. 5). 따라서 p형 반도체와 n형 반도체의 홀 전압 그래프(FIG. 1, FIG. 2)는 자기장에 대한 홀 전압 그래프로 보아도 무방하다.

- 1. 홀 전압 그래프를 보았을 때 p형과 n형의 경우 모두 홀 전압이 자기장에 대해 선형적으로 증가하였다가 자기장이 커짐에 따라 홀 전압의 증가 추세가 감소하는 것으로 보여진다. 이는 반도체 시료를 전자석의 정확한 중앙에 위치시키지 않아 전류에 따른 자기장이 반도체가 위치한 부분에서 균일하지 않게 증가하였기 때문이라고 추측할 수 있다.
- 2. p형 반도체의 홀 계수는 반도체에 흘려준 전류가 높아질 수록 그 평균값이 대략 0.5% 높게 계산되었 다. 흘려준 전류에 상관없이 홀 계수는 자기장이 증 가할 수록 작아지는 양상을 보였고 이는 1에서 언급

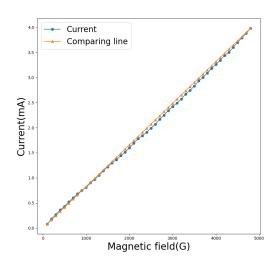


FIG. 5. 전자석의 자기장 크기에 대한 전류 그래프

- 한 홀 전압-자기장의 비선형성 관계에 의한 것이다. 식 (1)에 의하면 홀 계수는 홀 전압-자기장 그래프 의 기울기에 비례하는데 FIG. 1에서 볼 수 있듯이 그래프의 기울기는 자기장이 높아질 수록 감소한다. 이로 인해 홀 계수가 작아지는 양상을 보였다.
- 3. n형 반도체의 홀 계수는 반도체에 흘려준 전류가 높아졌을 때 그 평균값이 대략 10% 높게 계산되었다. 이는 p형 반도체의 증가치에 비해 현저히 큰 값이다. 홀 계수가 작아지는 양상을 p형 반도체와 일치하였으며 2에서 분석한 p형 반도체의 경우와 홀계수가 감소한 이유가 같다. 반도체에 흘려준 전류값이 달라졌을 때 홀 계수가 p형 반도체에 비해 크게 변한 이유는 반도체에 흘려주는 전류를 바꾸면서 반도체의 위치 또한 재조정 시켰기 때문이라고생각한다. 반도체의 위치가 달라졌으므로 반도체에 작용하는 자기장의 크기가 달라져 같아야할 홀 계수가 달라진 것이다.